

РАСЧЕТ ПОЛЯ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА, ЗАЗЕМЛЕННОГО В ОБСАЖЕННОЙ СКВАЖИНЕ

Предлагается метод расчета поля источника постоянного тока, заземленного на обсадную колонку скважины в сложных геоэлектрических условиях. Задача решается суммированием полей точечных источников, распределенных по скважине. Обосновывается приближенный способ определения распределения стекающих токов. Метод демонстрируется в геоэлектрических условиях Восточной Сибири.

Широкое распространение наземно-скважинных способов электро-разведки возможно, по-видимому, лишь при условии использования обсаженных скважин. Однако заземление элементов приемно-питающей установки на обсадную металлическую колонну приводит к тому, что она существенно участвует в формировании электрического поля в Земле посредством своих параметров — удельного сопротивления материала, радиуса, длины, проводящего сечения. Соответственно возникает необходимость в решении прямых задач, учитывающих это обстоятельство. Цель данной работы — предложить метод решения таких задач в сложных условиях, но вначале проиллюстрируем влияние колонны на простом примере.

Колонна в полупространстве. Итак, среда — однородное проводящее полупространство с удельным сопротивлением ρ , которое от дневной поверхности пересекается полубесконечной колонной радиуса a с удельным сопротивлением материала ρ_M . Источник заземлен в точке z_0 (рис. 1, А)

Воспользовавшись известным [1] решением для среды с цилиндрическими границами и учтя дневную поверхность как плоскость симметрии двух решений, получим потенциал на дневной поверхности в виде

$$\varphi = \frac{I_0 \rho}{\pi^2} \cdot \int_0^{\infty} \frac{\cos(m \cdot z_0) \cdot K_0(mr) \cdot dm}{1 + m \cdot a \cdot (\rho/\rho_M - 1) \cdot K_0(m \cdot a) \cdot I_1(m \cdot a)}, \quad (1)$$

где I_0 — ток источника; $K_0(mr)$, $I_1(ma)$ — модифицированные функции Бесселя; r — расстояние на дневной поверхности от устья скважины до точки наблюдения (разнос).

Формула (1) справедлива для цилиндра любого радиуса и произвольного удельного сопротивления, но в нашем случае удельное сопротивление металла колонны на шесть порядков меньше ρ — удельного сопротивления вмещающей среды. Кроме того, радиус колонны много меньше величины разносов (r), на которых рассматривается потенциал. Поскольку сходимость интеграла в (1) определяется экспоненциальным спадом функции $K_0(mr)$, можно считать, что $m \cdot a \ll 1$. Таким образом, приходим к формуле

$$\varphi = \frac{I_0 \cdot \rho}{\pi} \cdot \int_0^{\infty} \frac{\cos(m \cdot z_0) K_0(m \cdot r) \cdot dm}{\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{q} \cdot \ln\left(\frac{\gamma \cdot m \cdot a}{2}\right)}, \quad (2)$$

где γ — постоянная Эйлера, а $q = \rho_M/(\pi \cdot a^2)$ имеет смысл сопротивления единицы длины колонны.

Из физических соображений ясно, что при уменьшении удельного сопротивления вмещающей среды или при увеличении продольного сопротивления колонны влияние ее должно падать. И в самом деле, выражение (2) при $(\rho/q) \rightarrow 0$ переходит в

$$\varphi_T = \frac{I_0 \cdot \rho}{\pi} \cdot \int_0^{\infty} \frac{\cos(m \cdot z_0) \cdot K_0(m \cdot r) \cdot dm}{\pi} = \frac{I_0 \rho}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{r^2 + z_0^2}}, \quad (3)$$

т. е. в выражение для потенциала точечного источника.

© 1992 Могилатов В. С.

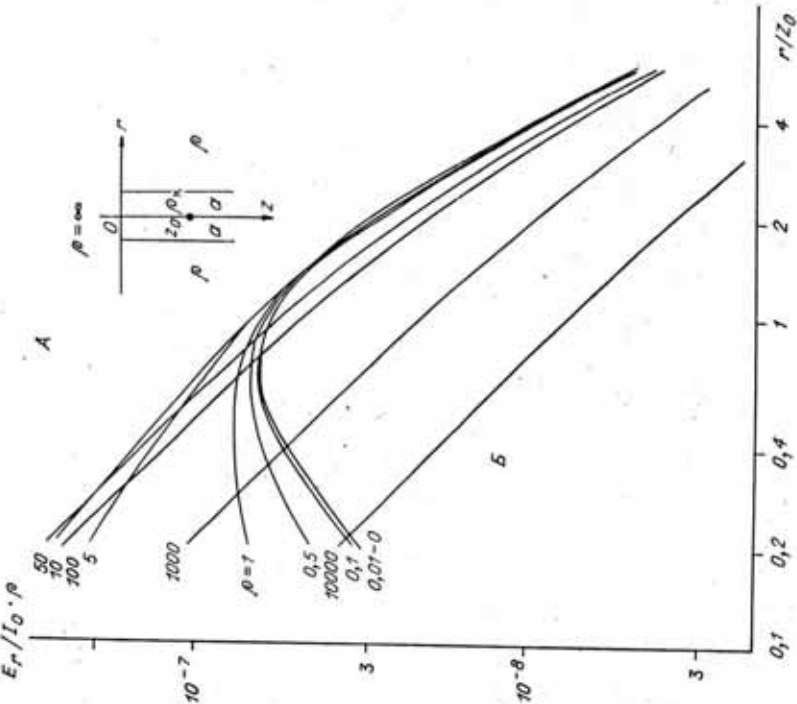


Рис. 1.

Результаты более детального анализа формулы (2) приведены на рис. 1, Б. Здесь представлены кривые градиента ($E_r / I_0 \cdot \rho$) в зависимости от расстояния для широкого диапазона сопротивлений среды. Источник подключен к колонне (стальная труба, внешний диаметр 0,2 м, внутренний — 0,18 м) на глубине 1000 м.

Отметим, что в диапазоне сопротивлений $0 \leq \rho \leq 0,1$ Ом·м поле от колонны на дневной поверхности практически не отличается от поля точечного источника (на рис. 1, Б этот диапазон представлен одной кривой). Следующий диапазон — 0,1 Ом·м $< \rho \leq 10$ Ом·м характеризуется тем, что приближение к полю точечного источника наблюдается при расстояниях $r \geq z_0$. Наконец, при $\rho > 50$ Ом·м имеет место все более резкий отход кривых от значений поля точечного источника — колонна становится все более эквипотенциальным проводником.

Как видно, различие в геоэлектрических условиях района исследования может существенно сказаться на выборе методики наземно-скважинных измерений. Например, для Сибирской платформы, где среднее удельное сопротивление вмещающих пород составляет 50—100 Ом·м, при уменьшении вертикальной электрической линии в ряд ли возможно, так как токи большей частью будут замыкаться просто по колонне. Использование же однополярного источника потребует при интерпретации учет влияния колонны.

С иными условиями сталкивается наземно-скважинная электроразведка при исследовании нефтегазовых месторождений в мезозойских отложениях Западно-Сибирской плиты, среднее удельное сопротивление которых составляет 3—5 Ом·м. Здесь заземления можно считать точеч-

ными, соответственно возможно использование вертикальной электрической линии.

Колонна в сложной среде. Выше рассмотрена задача для простейшей геоэлектрической среды. Появление хотя бы еще одной границы, кроме дневной, принципиально осложняет решение, приводя к необходимости применения громоздких численных процедур. Однако следующий прием (без существенного обоснования он использовался в работе [5]) позволяет свести задачу к двум более простым.

Допустим, что скважина длиной L , в которой заземлен источник постоянного тока, пересекает некоторый геоэлектрический разрез. Обсадочную колонну можно рассматривать как весьма протяженный линейный заземлитель с некоторым распределением стекающего тока. В общем случае это распределение зависит от всех параметров разреза. Предположим, что оно известно: с малого участка колонны Δl стекает в среду ток $\Delta I(l)$. Допустим также, что известен потенциал в любой точке пространства от точечного источника, помещенного в рассматриваемый разрез на глубине z_0 :

$$\Delta \varphi = \frac{\Delta I(l) \cdot \rho}{4\pi} \cdot \psi(l, x, y, z). \quad (4)$$

Тогда полный потенциал в любой точке от заряженной колонны можно записать как

$$\varphi(x, y, z) = \frac{\rho}{4\pi} \int_0^L \frac{dI(l)}{dl} \cdot \psi(l, x, y, z) dl, \quad (5)$$

где dI/dl — плотность распределения стекающего тока.

Несложно обобщить выражение (5) и на случай криволинейной скважины.

Итак, задача о поле заряженной колонны свелась к двум: распределение по скважине стекающего тока и поле точечного источника. Рассмотрим эти задачи.

Задача о поле точечного источника хорошо исследована, для произвольной горизонтально-слоистой среды известны выражения в виде квадратур или рядов, получены решения для некоторых частных случаев горизонтально-неоднородных сред [3], наконец, разработаны и программно реализованы алгоритмы для произвольных неоднородных сред [6].

Что касается другой задачи — отыскание распределения стекающего тока, то на первый взгляд она не выигрывает простоте, чем исходная, поскольку распределение стекающего тока нужно признать зависимым от любых геоэлектрических качеств разреза. Однако учитывая особые свойства обсадной колонны, рассматривая ее как длинную линейное заземление, допустив, что характер стекания зависит лишь от вмещающей среды, непосредственно окружающей колонну, можно решить эту задачу для произвольной изотропной горизонтально-слоистой среды. При этом решение будем считать справедливым и для горизонтально-неоднородных сред, если резкие нарушения горизонтальной однородности достаточно удалены от скважины. Метод решения был первоначально заимствован из [2], дальнейшее развитие и подробное обоснование условий его применимости изложены в [4].

Решение для поля заряженной колонны, полученное описанным выше способом, согласно (5), далее будем называть приближенным, имея в виду допущения, используемые при расчете распределения стекания тока.

Колонна в полупространстве. Приближенное решение. Проверим теперь метод, получив решение для колонны в полупространстве и сравнив его с полученным выше строгим решением.

Итак, пусть колонна длиной L помещена в полупространство с удельным сопротивлением ρ . Источник тока заземлен на глубине z_0 . Потенциал

на дневной поверхности от точечного источника с током ΔI , расположенного на глубине l , есть

$$\Delta \varphi = \frac{\Delta I(l) \cdot \rho}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{r^2 + z_0^2}} \quad (6)$$

Согласно [4], распределение плотности стекающего тока с колонны длиной L , помещенной в полупространство с удельным сопротивлением ρ , описывается следующим образом:

$$\frac{dI(l)}{dl} = -\frac{1}{g} \cdot U(l), \quad U(l) = \frac{I_0 q}{\alpha \cdot \text{sh}(\alpha \cdot L)} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{ch}[\alpha \cdot (L - z_0)] \cdot \text{ch}(\alpha \cdot l), \quad 0 \leq l \leq z_0 \\ \text{ch}(\alpha \cdot z_0) \cdot \text{ch}[\alpha \cdot (L - l)], \quad z_0 \leq l \leq L \end{array} \right. \quad (7)$$

где $\alpha = \sqrt{q/g}$, $q = \rho \pi / S_m$ — отношение удельного сопротивления материала колонны к ее проводящему сечению, т. е. q — сопротивление единицы длины колонны протекающему току; $g = k \cdot \rho$ — сопротивление току стекания с одного метра колонны; k — коэффициент, слабо зависящий от длины и радиуса колонны.

Если представить колонну вытянутым эллипсоидом вращения с полуосями $L/2$ и a , то можно принять [2]:

$$k = \frac{1}{2\pi} \cdot \ln \left(\frac{L}{a} \right). \quad (8)$$

Теперь потенциал на дневной поверхности от заряженной колонны, согласно (5), можно записать как

$$\varphi = -\frac{\rho}{2\pi g} \cdot \int_0^L \frac{U(l) \cdot dl}{\sqrt{r^2 + z_0^2}}. \quad (9)$$

Воспользовавшись соотношением

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 + l^2}} = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\pi/2} K_0(m \cdot r) \cdot \cos(m \cdot l) \cdot dm,$$

устривив величину L в бесконечность и производя интегрирование по l , получим выражение

$$\varphi = \frac{I_0 \cdot \rho}{\pi^2} \cdot \int_0^{\infty} \frac{\cos(m \cdot z_0) \cdot K_0(m \cdot r) \cdot dm}{1 + \frac{m^2}{\alpha^2}}$$

или, учитывая определения α и g ,

$$\varphi = \frac{I_0 \cdot \rho}{\pi} \cdot \int_0^{\infty} \frac{\cos(m \cdot z_0) \cdot K_0(m \cdot r) \cdot dm}{\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{g} \cdot (-2 \cdot \pi \cdot k)}. \quad (10)$$

в отличие от строгого решения (2), которое здесь снова вышнем:

$$\varphi = \frac{I_0 \cdot \rho}{\pi} \cdot \int_0^{\infty} \frac{\cos(m \cdot z_0) \cdot K_0(m \cdot r) \cdot dm}{\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{g} \cdot \ln \left(\frac{\gamma \cdot m \cdot a}{2} \right)}$$

Сравнение этих выражений показывает, что приближение состоит в том, что в подынтегральном выражении функции $\ln(\gamma \cdot m \cdot a/2)$ заменяется на константу $(-2 \cdot \pi \cdot k)$. Воспользовавшись характером зави-

симости подынтегральной функции в (2) от m , можно предложить формулу для k в случае полубесконечной колонны:

$$k = \frac{1}{2\pi} \cdot \ln \left(\frac{l}{a} \right), \quad (11)$$

которая по форме близка к выражению коэффициента k для колонны конечной длины (8) (l_0 — масштабная единица длины, принятая в дальнейшем равной 1000 м).

Использование выражения (10) вместо (2) означает необходимость признать зависимость коэффициента k от всех параметров (r , ρ , z_0), входящих в подынтегральное выражение. Рассмотрим эти зависимости.

Зависимость от радиуса r . Из общих физических соображений можно предположить, что с удалением точки измерений от скважины различие между точным решением (2) и приближенным (10) будет уменьшаться. Как показывают расчеты, относительная ошибка меньше 2% при $r \geq 600$ м ($z_0 = 1000$ м, $\rho = 100$ Ом · м).

Зависимость от ρ . Анализ расчетов по формулам (2) и (10) показывает, что изменение удельного сопротивления вмещающего колонну полупространства слабо влияет на относительную погрешность. Можно брать значение k , при котором ошибка при использовании приближенного решения (10) будет допустимой в широком диапазоне значений ρ . Например, для $z_0 = 1000$ м при $k = 1.5$ обеспечивается отличие от точного решения менее 3% при $1 \leq \rho \leq 100$ Ом · м.

Зависимость от z_0 . Сравнение точного и приближенного расчетов для различных значений z_0 показывает, что при $r \geq 600$ м и $r > 1$ Ом · м ошибка не превышает 2%.

Можно сделать общий вывод, практически важный: в широком диапазоне используемого диапазона наименьшей параметров z_0 , ρ , r коэффициент k — коэффициент пропорциональности между сопротивлением стеканию тока с колонны и удельным сопротивлением среды достаточно положить равным 1.5, чтобы обеспечить относительную ошибку приближенного решения в 3% — не более. Таким образом, в принятом нами определении сопротивления току стекания постоянно вдоль колонны и зависит (линейно) только от удельного сопротивления вмещающей среды. Однако этот вывод мы сделали на основании сравнения точного и приближенного решений для полубесконечной колонны. Вполне допустимо, что для реальной колонны конечной длины сопротивление стеканию будет значительно меняться вдоль скважины. На рис. 2 представлена кривая сопротивления току стекания ($s = 1$ м), построенная по расчетам, выполненным В. С. Моисеевым и сотрудниками по методу электротехнического эквивалента [7] для скважины длиной 3000 м и $\rho = 5$ Ом · м. Сами значения g (~ 10 Ом · м) отличаются от нашего значения $g = 1.5 \cdot \rho = 7.5$ Ом · м, поскольку при расчете методом электротехнического эквивалента поверхность скважины разворачивалась в плоскость (одностороннюю) и сопротивление вследствие этого завышалось, однако «краевой» эффект в этом методе учитывался (см. рис. 2), но им можно пренебречь и считать сопротивление стеканию постоянным по колонне.

Поле колонны, пересекающей S-плоскость. Мы констатировали, что предлагаемый способ решения задачи о поле колонны с использованием приближенного определения распределения стекающего тока вполне оправдан, по крайней мере, в однородном полупространстве. Показано, что и в резко неоднородной по вертикали среде приближенное решение достаточно близко к точному, причем при том же значении k .

В качестве такой среды, позволяющей получить точное решение, возьмем однородное пространство с удельным сопротивлением ρ , вмещаю-

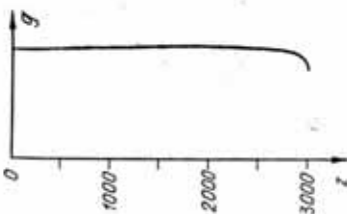


Рис. 2.

щее плоскость S с проводимостью S_n . Бесконечная колонна пересекает все пространство и S -плоскость по оси z . Источник помещен в начало координат — в точку пересечения оси скважины (ось z) с плоскостью S .

Строгое решение получим несколько иначе, чем мы это сделали для полупространства, заменив колонну S -поверхностью в виде цилиндра радиуса a с продольной проводимостью S_n . Для такой модели удается разделить переменные в краевой задаче для потенциала в цилиндрической системе координат.

Удовлетворив обычным требованиям для потенциала и условиям для градиентов на S -поверхностях:

$$[E_z]_{S_K} = 0, \quad [H_\phi]_{S_K} = -S_K \cdot E_z,$$

$$[E_z]_{S_\Pi} = 0, \quad [H_\phi]_{S_\Pi} = S_\Pi \cdot E_r \quad (12)$$

разделяя переменные в уравнении Лапласа, получим, что

$$\begin{aligned} \Psi = & \frac{I_0 \rho}{2\pi} \int_0^\infty K_0(m \cdot r) \cdot \left\{ \frac{\cos(m \cdot z)}{\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{q}} \cdot \ln \left(\frac{\gamma \cdot m \cdot a}{2} \right) - \right. \\ & \left. - \rho \cdot S_\Pi \cdot \frac{[\cos(mz) + |\sin(m \cdot z)|]}{\left[\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{q} \cdot \ln \left(\frac{\gamma \cdot m \cdot a}{2} \right) \right] \cdot [2 + m \rho \cdot S_\Pi]} \right\} \cdot dm, \end{aligned} \quad (13)$$

где $q = 1/(2 \cdot \pi \cdot a^2 \cdot S_K \cdot S_\Pi)$ — продольное сопротивление колонны. Здесь учтено, что $r \gg a$ и $\rho/\rho_m \sim 10^6$.

Первый член представляет собой решение для потенциала в отсутствие S -плоскости, второй — аномальная часть Ψ .

Найдем теперь приближенное решение. По предлагаемому рецепту необходимо сначала получить распределение стекающего тока с колонны, пересекающей пространство и плоскость S , что можно сделать, воспользовавшись результатами работы [4]. Кроме того, нужно знать выражение для потенциала точечного источника при произвольном его положении на оси z для той же среды. Подставив соответствующие функции в (5) и проинтегрировав по бесконечной колонне, получим

$$\begin{aligned} \Psi = & \frac{I_0 \rho}{2\pi} \int_0^\infty K_0(mr) \cdot \left\{ \frac{\cos(m \cdot z)}{\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{q}} \cdot (-2\pi \cdot k) - \right. \\ & \left. - \rho \cdot S_\Pi \cdot \frac{[\cos(m \cdot z) + |\sin(m \cdot z)|]}{\left[\pi - \frac{m^2}{2} \cdot \frac{\rho}{q} \cdot (-2\pi \cdot k) \right] [2 + m \rho \cdot S_\Pi]} \right\} \cdot dm. \end{aligned} \quad (14)$$

Сравнение формул (13) и (14) показывает, что, как и в случае однородного пространства, приближение сводится к тому, что в подынтегральном выражении функции $\ln(\gamma \cdot m \cdot a/2)$ заменяется на константу $(-2 \cdot \pi \cdot k)$. Сравнение численных расчетов, проведенных по обеим формулам, показывает, что величина k , при которой погрешность приближения менее 5%, одинакова как для нормального поля, так и для аномального, и для всех реальных значений параметров ρ , S_Π , r близка к 4.5. Поле колонны в сложных средах. Считая развитый выше метод расчета поля от обсадной колонны достаточно обоснованным, применим его к ситуациям более сложным.

Во-первых, заметим, что нетрудно получить решение для колонны в произвольной горизонтально-слонстой среде. Поле точечного источника хорошо изучено, а распределение стекающего тока с колонны, пере-

секающей N -слойную горизонтально-слонстую среду, нетрудно получить, пользуясь нашим приближенным способом. Не приводя формулы, отметим, что окончательный результат после интегрирования по скважине представляется в виде квадратуры, которую нужно вычислять на ЭВМ.

Применим предлагаемый метод расчета в ситуации, характерной для условий Сибирской платформы. Получим решение для поля колонны, пересекающей водонасыщенную часть коллектора, моделируемую S -диском, перекрытого экраном — T -плоскостью. Вмещающая среда — однородный пласт на изолирующем основании. Пусть S -диск расположен в основании пласта, т. е. его мощность $h \ll L$ — длины колонны. T -плоскость помещена на глубине h_Π .

Поле точечного источника в таких условиях получим методом, использованным в работе [3]:

$$\Psi(r, z, l) = \frac{J_0 \rho}{4\pi} \int_0^\infty J_0(m \cdot r) \cdot F(m, z, l) \cdot dm \quad (15)$$

на дневной поверхности ($z = 0$)

$$F(m, 0, l) = F_N(m, 0, l) + \tau \cdot \frac{\partial F(m, h_\Pi, l)}{\partial z} + F_D(m, 0, l),$$

где (l — положение источника, ось z — вниз)

$$F_N(m, z, l) = \frac{2}{\text{sh}(m \cdot h)} \times \left\{ \begin{aligned} & \text{ch}(m \cdot z) \cdot \text{ch}[m(h-l)], \quad z \leq l, \\ & \text{ch}[m(h-z)] \cdot \text{ch}(ml), \quad z \geq l, \end{aligned} \right.$$

$$\tau = \frac{T_\Pi}{\rho} \cdot \frac{\text{sh}[m \cdot (h - h_\Pi)]}{\epsilon}$$

$$F_D = -\frac{m \cdot D}{\epsilon} \cdot \rho \cdot S_D \cdot R_D \int_0^\infty \Psi_S \cdot m' \cdot \left[F_D + F_N(m', 0, l) - \tau_0 \frac{\partial F_N(m', h_\Pi l)}{\partial z} \right] dm',$$

$$D = \text{ch}(m \cdot h) + \frac{T_\Pi}{\rho} \cdot \frac{\text{ch}[m \cdot (h - h_\Pi)] \cdot \text{sh}(m \cdot h_\Pi)}{\epsilon}, \quad (16)$$

$$\tau_0 = \frac{T_\Pi}{\rho} \cdot \frac{\text{sh}(m h_\Pi)}{\epsilon}$$

$$e = \text{sh}(ml) + \frac{T_\Pi}{\rho} \cdot m \cdot \text{sh}(m \cdot h_\Pi) \cdot \text{sh}[m \cdot (h - h_\Pi)],$$

$$\Psi_S = \frac{m' \cdot J_1(m' \cdot R_\Pi) \cdot J_0(m' \cdot R_D) - m' \cdot J_0(m' \cdot R_\Pi) \cdot J_1(m' \cdot R_D)}{m'^2 - m'^2}$$

T_Π — поперечное сопротивление экрана; S_D — продольная проводимость S -диска; R_D — радиус S -диска.

Для определения F_D как функции от m необходимо решить интегральное уравнение (16).

Распределение стекающего тока получим, воспользовавшись результатами (4). В нашем приближении наличие T -плоскости не влияет на распределение стекающего тока:

$$\frac{dI}{dl} = \frac{1}{g} [U_N(l, z_0) + U_S(l, z_0)], \quad (17)$$

где

$$U_N(l, z_0) = \frac{I_0 \rho}{\alpha} \cdot \frac{1}{\text{sh}(\alpha h)} \left\{ \begin{aligned} & \text{ch}[\alpha \cdot (h - z_0)] \cdot \text{ch}(\alpha \cdot z), \quad 0 \leq l \leq z_0, \\ & \text{ch}(\alpha \cdot z_0) \cdot \text{ch}[\alpha \cdot (h - l)], \quad z_0 \leq l \leq h, \end{aligned} \right.$$

$$U_S(l, z_0) = -\frac{S_D \cdot \rho \cdot \alpha \cdot U_N(h, z_0) \cdot \text{ch}(\alpha l)}{\text{sh}(\alpha h) + S_D \cdot \rho \cdot \alpha \cdot \text{ch}(\alpha h)}$$

g — продольное сопротивление 1 м колонны, $g = k \cdot \rho$ — сопротивление току стекания с 1 м; $\alpha = \sqrt{g/g}$ — важнейший параметр, определяющий

всю «гиперболическую» картину распределения стекающего тока. Можно представить α как

$$\alpha = \sqrt{\frac{\rho_M \cdot 1}{\rho \cdot S_M k}}$$

Поскольку величины k и S_M — проводящее сечение колонны — стабильны, то α определяется корнем из отношения удельных сопротивлений металла колонны и окружающей породы.

Итак, в соответствии с предлагаемой методикой с пересеканием пласт, содержащий T -плоскость на глубине h_H и S -диск на глубине h (в основании пласта), согласно (5), определяются как

$$\varphi(r, z, z_0) = \frac{\rho}{4\pi} \int_0^h \frac{dI(l, z_0)}{dl} \int_0^\infty J_0(mr) F(mz, l) \cdot dm \cdot dl, \quad (18)$$

где z_0 — положение заземления источника в колонне.

Интеграл по колонне от 0 до h берем аналитически, используя различные условия, и окончательно найдем для потенциала на дневной поверхности от заряженной колонны:

$$\begin{aligned} \varphi(r, 0, z_0) = & -\frac{I_0 \rho \alpha}{4\pi} \int_0^\infty \frac{J_0(mr)}{\alpha^2 - m^2} \left[-\frac{dI(h_H, z_0)}{dl} \cdot \frac{2 \cdot m \cdot \tau}{I_0 \alpha} + \alpha \cdot F_{II}(m, 0, z_0) + \right. \\ & \left. + \alpha \cdot \tau \frac{\partial F_{II}(m, h_H, z_0)}{\partial l} - \frac{dI(0, z_0)}{dl} \cdot \frac{2 \cdot m}{I_0 \alpha} - \frac{S_D \cdot \rho \cdot \alpha \cdot dI(h, z_0)}{I_0} \right] \times \\ & \times \left[F_{II}(m, 0, h) + \tau \cdot \frac{\partial F_{II}(m, h_H, h)}{\partial l} \right] + X/D \} dm, \quad (19) \end{aligned}$$

где X удовлетворяет уравнению

$$\begin{aligned} X = & -\frac{m \cdot D}{e} \cdot \rho \cdot S_D \cdot R_D \cdot \int_0^\infty \psi_S \cdot m' \cdot (X + X_H) dm', \\ X_H = & -\frac{d^2 I(0, z_0)}{dl^2} \cdot \frac{1}{I_0 \alpha} + \alpha \cdot F_{II}(m, h, z_0) - \alpha \cdot \tau_0 \cdot \frac{d \cdot F_{II}(m, h_H, z_0)}{dl} + \\ & + \frac{dI(h, z_0)}{dl} \cdot \frac{1}{I_0 \alpha} \cdot \left[-\alpha^2 \cdot \rho \cdot S_D \cdot F_{II}(m, h, h) + \alpha^2 \cdot \rho \cdot S_D \cdot \tau_0 \cdot \frac{\partial F_{II}(m, h_H, h)}{\partial l} - 2m \right]. \end{aligned}$$

Далее необходимо производить численный расчет. Соответствующая программа была составлена и использовалась для анализа возможностей определения положения края водонасыщенной части коллектора для условий Восточной Сибири (в частности, для Даниловской площади). Здесь мощность проводящей толщи $h=2000$ м, $\rho=75$ Ом·м. Объект — водонасыщенная часть коллектора — моделируется в основании пласта диском с продольной проводимостью $S_D=25$ Ом⁻¹. Экранирующие выносимые отложения (трашсы, соли) моделируются T -плоскостью с номинальным сопротивлением до $T_{II}=5 \cdot h \cdot \rho$ на глубине 1000 м. Параметр α имеет значение 10^{-2} м⁻¹, т. е. влияние колонны значительно, но ее нельзя считать эквипотенциальным заземлением.

На рис. 3 приведен фрагмент этого исследования. Здесь представлены трансформированные кривые поля (градиента E_r) по профилю — радиусу от устья скважины. Трансформация имеет целью подчеркнуть положение края и заключается в нормировании полного поля E_r на нормальное поле E_r^H (т. е. для той же установки и среды, но без объекта) с последующим дифференцированием. Положение края ($R_D=6000$ м) отмечается максимумом. Источник заземлен на глубину 1600 м.

Кривая 7 дает наиболее четкое определение положения края диска. Это случается, когда отсутствуют экран и колонна. Заземление на колонну (кривая 1) в отсутствие экрана слабо сказывается на точности определения края. Кривые 2 и 3 рассчитаны с учетом экрана соответственно для точечного и заземленного на колонну источников. ЭДС над краем со стороны линии на 1 А тока источника составляет 60—80 мкВ.

В заключение подчеркнем, что, несмотря на имеющиеся программные комплексы для расчета полей в произвольных трехмерных средах, необходимость в специализированных алгоритмах, как, например, для источника, заземленного на обсадную колонну, несомненно, поскольку это снижает требования к ресурсам ЭВМ и позволяет оперативно отвечать на вопросы методики полевых работ и интерпретации результатов наблюдений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дахов В. Н. Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений. — М.: Гостехиздат, 1953. — С. 111—113.
2. Заборовский А. И. Электроразведка. — М.: Гостехиздат, 1963. — С. 39—44.
3. Могилатов В. С. Математическое моделирование задач наземно-скважинной электроразведки // Геология и геофизика. — 1983. — № 3. — С. 141—146.
4. Могилатов В. С., Гевдзьяни А. М. О возможности использования обсаженных скважин в наземно-скважинной электроразведке на нефть и газ в условиях Сибирской платформы // Геология и геофизика. — 1983. — № 12. — С. 99—105.
5. Могилатов В. С., Горюшко Н. В. Стабилизация поля от источника, заземленного в обсаженной скважине // Геология и геофизика. — 1986. — № 12. — С. 101—105.
6. Хугоранский В. К. О вычислении стационарного электрического поля в сложнопостроенных средах // Геология и геофизика. — 1984. — № 11. — С. 98—106.
7. Моисеев В. С., Талашев А. С. Оценка возможности применения наземно-скважинной электроразведки для решения нефтисловесных задач в Восточной Сибири // Повышение эффективности геофизических методов поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на основе математического моделирования. — Новосибирск: СНИИГГ-ИМС, 1986. — С. 47—58.

ИПО Сибгео
Новосибирск

V. S. MOGILATOV

CALCULATION OF ELECTRIC FIELD EXCITED BY CURRENT SOURCE GROUNDED ON CASING IN DRILL HOLE

Поступила в редакцию
12 марта 1991 г.

The method for calculation of electric field strength for the case when the source of constant current is grounded on casing is proposed. This method may be used under complex geoelectric conditions. The problem is resolved by summation of fields of point sources distributed along drill hole. An approximated way for determining current sheet is justified. The possibility of this method is illustrated under geoelectric conditions of East Siberia.